



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1. Рабочий спектральный диапазон: 240 – 1050 нм (УФ и ИК опции)
2. Диаметр измерительного пятна: 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм, 100 мкм
3. Измеряемые параметры: Толщина пленки, n и k через λ
4. Диапазон толщин: от 0.1 нм до 10 мкм (зависит от типа пленки)
5. Количество анализируемых слоев: до 10 слоев (зависит от типа пленки)
6. Скорость анализа: 10 сек/точка (нормальный режим); 1-3 сек/точка (быстрый режим – опционально)
7. Воспроизводимость (3σ): ± 0.03 нм на 10 измерений



MICRO SPOT Eli-SE

Система для измерения тонких пленок

Спектральная эллипсометрия (SE) является отраслевым стандартом, который позволяет одновременно измерять толщину и оптические константы тонких пленок одновременно, а также используется для определения характеристик различных материалов (например, диэлектриков, полупроводников, органических веществ и т.д.), включая просветляющие покрытия, OLED дисплеи и полимерные пленки.

Эллипсометрическая система

Источник света	Вольфрамово-галогенная и дейтериевая лампы (190 – 1050 нм)
Модуль поляризатора	Коллимирующая оптическая система; вращающийся поляризатор
Модуль анализатора	Вращающийся анализатор: микрошаговый двигатель
Угол падения излучения	45° – 90°, шаг 5° (ручное управление) (автоматическая смена углов – опционально)
Эллипсометрические углы	Ψ : 0° – 90°, воспроизводимость $\leq \pm 0.02^\circ$ Δ : 0° – 180°, воспроизводимость $\leq \pm 0.1^\circ$
Система выравнивания	Автоколлиматор
Система перемещения образца	X, Y, Z, наклон, изменяемый угол
Предметный столик	До Ø300 мм

Области применения

Полупроводники, дисплеи (включая OLED), диэлектрики, полимеры, химия, солнечные элементы

При поддержке корейского института оценки промышленных технологий



Официальный дистрибьютор в РФ ООО «ПромЭнерголаб»
105318, Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, 1
Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208
E-mail: info@czl.ru, www.czl.ru